

令和元年10月1日付オープンファシリティ利用料金改定
 <委託分析・委託加工等料>

装置番号	区分	加工等設備	メーカー	型式	学外利用者					
					加工等料(学外・公的機関) (1時間あたり)			加工等料(学外・一般) (1時間あたり)		
					現行 R1.9.30まで	改定後 R1.10.1から	増額	現行 R1.9.30まで	改定後 R1.10.1から	増額
28	クリーン ルーム内 設置装置	マスクアライナー	ミカサ	MA-20	9,700	10,700	1,000	10,200	11,200	1,000
29		真空蒸着装置	サンバック	ED-1500R	9,700	10,700	1,000	10,200	11,200	1,000
30		反応性イオンエッチング装置	サムコ	RIE-10NRV	12,000	13,200	1,200	13,200	14,500	1,300
31		ICP高密度プラズマエッチング装置	サムコ	RIE-10iHS	14,900	16,400	1,500	17,000	18,700	1,700
33		ICPドライエッチング装置	住友精密工業	SPM-200	12,700	14,000	1,300	14,100	15,500	1,400
34		液体ソースプラズマCVD装置	サムコ	PD-10C1	8,500	9,300	800	8,600	9,500	900
32		プラズマCVD装置	サムコ	PD-220ESN	13,100	14,400	1,300	14,600	16,100	1,500
35		ヘリコンスパッタリング装置	アルバック	MPS-4000C1/HCI	12,100	13,400	1,300	13,400	14,700	1,300
37		超高精度電子ビーム描画装置 125kV	エリオニクス	ELS-F125-U	17,200	18,900	1,700	19,900	21,900	2,000
58		真空紫外光露光装置	エヌ工房	フォトエテナー PC-01-H	8,400	9,300	900	8,500	9,400	900
77		超高精度電子ビーム描画装置 100kV	エリオニクス	ELS-7000HM	15,900	17,500	1,600	18,200	20,000	1,800
145		超高速スキャン高精度電子ビーム露光装置	エリオニクス	ELS-F130HM	40,700	44,800	4,100	50,500	55,600	5,100
85		レーザー描画装置	ネオアーク	DDB-201-200	11,800	13,000	1,200	12,900	14,200	1,300
86		原子層堆積装置	Picosun	SUNALE-R	13,700	15,100	1,400	15,400	17,000	1,600
131		コンパクトスパッタ装置	アルバック	ACS-4000-C3-HS	12,300	13,600	1,300	13,600	15,000	1,400
146	半導体薄膜堆積装置	パスカル	PAC-LMBE	14,600	16,100	1,500	16,500	18,200	1,700	
103	理学部棟内	超広帯域波長可変レーザー分光装置	スペクトラ・フィジックス	Tsunami3941-X1S,Opal1.3	8,300	9,200	900	9,000	9,900	900
109		集束イオンビーム加工装置	エリオニクス	EIP-3300	11,600	12,700	1,100	12,600	13,900	1,300
46	分光分析装置	フーリエ変換赤外線吸収分光光度計 (FT-IR)	日本分光	FT/IR 660Plus	9,500	10,500	1,000	9,900	10,900	1,000
49		紫外可視近赤外分光光度計	パーキンエルマー	Lamda 900S	9,200	10,100	900	9,500	10,500	1,000
72		ICP発光分析装置	島津製作所	ICPE-9000	11,900	13,200	1,300	12,900	14,300	1,400
79		顕微鏡ラマンマイクロスコピーシステム	レニショー	inVia Reflex	12,400	13,600	1,200	13,700	15,100	1,400
132		振動円偏光二色性分光光度計	日本分光	JV-2001M	10,500	11,500	1,000	11,200	12,300	1,100
45	電磁波 分析装置	X線光電子分光装置	日本電子	JPS-9200	14,900	16,400	1,500	17,000	18,700	1,700
44		X線回折装置	リガク	RINT-2000/PC	10,200	11,300	1,100	10,900	12,000	1,100
139		X線回折装置	リガク	Smart Lab	17,000	18,700	1,700	19,600	21,600	2,000
40		高分解能X線回折装置	ブルカー・エイエックスエス	D8 Discover	13,800	15,200	1,400	15,500	17,100	1,600
41		分光	超薄膜評価装置	日立	HD-2000	16,700	18,400	1,700	19,300	21,200
147		時間分解光電子顕微鏡システム	エルミテック	PEEM-III	17,500	19,300	1,800	20,300	22,400	2,100
157	電磁気 分析装置	リアイオントラップ・フーリエ変換質量分析装置	サーモフィッシャーサイエンティフィック	Orbitrap Elite	44,100	49,000	4,900	48,100	53,400	5,300
158		高分解能飛行時間型質量イメージングシステム	ブルカー・ダルトニクス	ultraXtreme-DHSZ TOF/TOF	50,400	56,100	5,700	53,600	59,700	6,100
119		飛行時間型質量分析装置	パーセプティブバイオシステムズ	Voyager DE-STR	13,600	14,900	1,300	15,200	16,700	1,500
141		誘導結合プラズマ質量分析装置	アジレント・テクノロジー	8800 ICP-QQQ	15,000	16,600	1,600	17,100	18,900	1,800
121		核磁気 共鳴	超伝導フーリエ変換核磁気共鳴装置(液体試料専用)	ブルカー・バイオスピン	AVANCE DRX600	28,100	30,900	2,800	34,100	37,500
134		600MHz 固体高分解能核磁気共鳴装置(固体試料専用)	ジオル・レゾナンス	ECA600 II	22,300	27,600	5,300	26,600	33,200	6,600
47	画像分析装置	分子間力プローブ顕微鏡	Asylum Research	Molecular Force Probe 3D	11,300	12,500	1,200	11,700	13,000	1,300
61		電界放射型走査型電子顕微鏡	日本電子	JSM-6700FT	9,100	10,100	1,000	9,500	10,400	900
62		走査型プローブ顕微鏡	日本電子	JSPM-4210	8,200	9,000	800	8,300	9,100	800
221		走査型プローブ顕微鏡	島津製作所	SPM-9600	11,000	12,200	1,200	11,200	12,400	1,200
63		走査型電子顕微鏡	日立ハイテクノロジーズ	S-3500N	9,800	10,800	1,000	10,300	11,300	1,000
76		分子間力プローブ顕微鏡	アサイラム テクノロジー	MFP-3D-BIO-J	18,100	20,000	1,900	18,800	20,800	2,000
76					14,000	15,500	1,500	14,700	16,200	1,500
122		電界放射型透過型電子顕微鏡	日本電子	JEM-3200FS	18,300	20,200	1,900	21,400	23,600	2,200
148	画像取得装置	収差補正走査型透過電子顕微鏡	日本電子	JEM-ARM200F	37,300	41,000	3,700	46,000	50,700	4,700
42	成膜・加工装置	集束イオンビーム加工観察装置	日立	FB-2100	13,200	14,600	1,400	14,700	16,300	1,600
178	バイオ関連分析 装置	次世代シーケンサーシステム	イルミナ	HiSeq2500システム	79,200	88,300	9,100	85,100	94,800	9,700
161		卓上セルソーラーシステム	ペイバイオサイエンス	JSANデスクトップ DCS-380	35,600	39,600	4,000	37,500	41,700	4,200
104		高速レーザー共焦点顕微鏡(Station1)	ニコン	A1	12,900	14,300	1,400	14,400	15,900	1,500
105		全反射蛍光顕微鏡(Station2)	ニコン、日本ローバー	TE-2000、EM-CCDカメラ	11,200	12,400	1,200	12,200	13,400	1,200
106		多色蛍光タイムラプス顕微鏡(Station3)	ニコン	Ti-E	9,900	11,000	1,100	10,500	11,600	1,100
107	リアルタイム共焦点顕微鏡(Station4)	ニコン、横河電機	Ti、CSU-10	10,000	11,000	1,000	10,600	11,700	1,100	
87	専用測定装置	ソーラシミュレータ	ワコム電創	WXS-156S-L2,AM1.5GMM	12,000	13,200	1,200	13,100	14,500	1,400
179		複合量子ビーム超高压電子顕微鏡	日本電子	JEM-ARM1300	13,900	15,400	1,500	15,700	17,300	1,600
180		レーザー超高压電子顕微鏡	日立	H-1300	13,700	15,100	1,400	15,500	17,000	1,500
137	理学研究 画像分析 装置	口径1.6m光学望遠鏡(マルチスペクトル撮像観測装置使用時)	自作	-	38,200	42,000	3,800	47,200	51,900	4,700

技術相談料(公的機関) (1時間あたり)			技術相談料(一般) (1時間あたり)		
現行 R1.9.30まで	改定後 R1.10.1から	増額	現行 R1.9.30まで	改定後 R1.10.1から	増額
10,000	11,000	1,000	13,000	14,300	1,300